

### 講演予稿執筆・投稿要領

用紙(A4 版、1 枚)の上部 25mm、左右下部 20mm を余白にし、上から題目、発表者・所属、本文の順でご執筆ください。テンプレートをホームページからダウンロードしてご利用ください。予稿原稿は PDF ファイルにて ion-sympo@ml.hosei.ac.jp 宛にご送付ください。

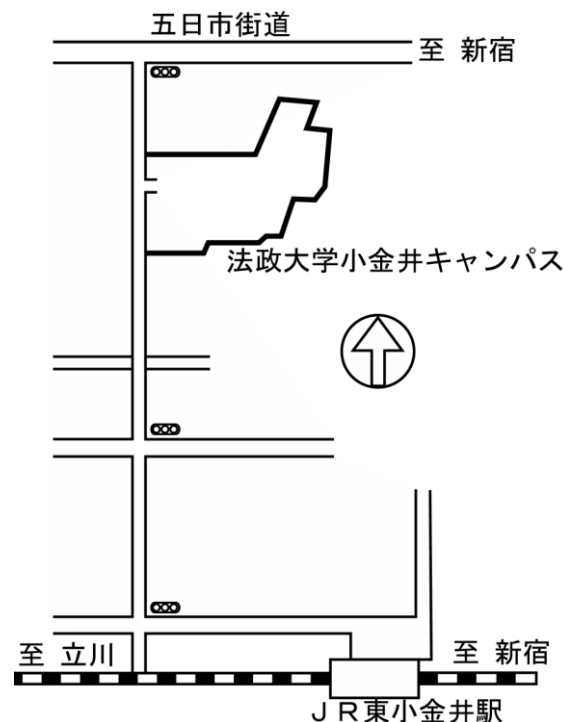
### 論文 (Proceedings・英文)執筆要領

A4 用紙の上下左右 30mm を余白にし、上から題目(大文字)、著者名、所属、アブストラクト(200 語まで、シングルスペース)、本文(シングルスペース)の順で 3 ページ以上ご執筆ください。オフセット印刷にて B5 版に縮刷されます。文献番号は本文中に上付き数字にて指示してください。また、参考文献は、本文の末尾にまとめ、番号、著者、Journal 名、巻(太文字)、ページ、発表年の順でご記載ください。

予稿原稿と同様に テンプレートをホームページからダウンロードしてご利用ください。完成原稿は PDF ファイルにて ion-sympo@ml.hosei.ac.jp 宛にご送付ください。

### シンポジウム HP

<https://www.hosei.ac.jp/ionbeam/katsudo/>



JR 中央線東小金井駅(北口)より  
徒歩 12 分または、  
バス 京王バス 関野橋循環にて  
「法政大学」下車

\*お車でのご来校はご遠慮ください

### 問い合わせ先

〒184-8584

東京都小金井市梶野町 3-7-2

法政大学イオンビーム工学研究所

TEL : 042-387-6094

FAX : 042-387-6095

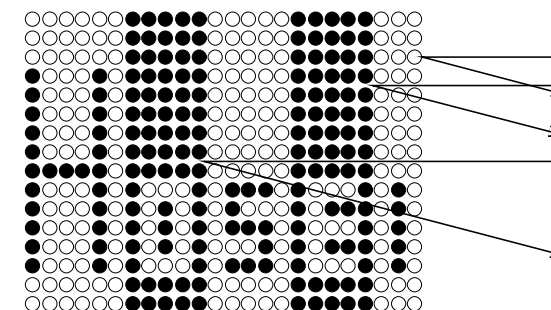
HP : <https://www.hosei.ac.jp/ionbeam/>

E-MAIL : ion-sympo@ml.hosei.ac.jp



## 第 45 回法政大学 イオンビーム工学研究所 シンポジウム

The 45<sup>th</sup> Symposium on  
Materials Science and Engineering  
Research Center of Ion Beam Technology  
Hosei University



期日 2026 年 12 月 9 日 (水)  
会場 法政大学小金井キャンパス  
マルチメディアホール及び  
東館体育館前フロア  
主催 法政大学イオンビーム工学研究所  
協賛 日本物理学会  
応用物理学会  
日本アイソトープ協会 (順不同)

講演は招待講演と一般講演で構成され、一般講演ではショート講演とポスターセッションを予定しております。

また、シンポジウムで発表された論文はProceedings(2026)として2027年3月に発行する予定です。

林 賢太郎 氏 (ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社)  
「凹面鏡を有する GaN 系 VCSEL および  
高密度アレイ光源の進展」

下記のようなキーワードで募集しますが、イオンビーム利用技術に限らず関連材料・技術に関する発表を広く募集いたします。

- ①「発表題目」「所属」「発表者名（共同発表者名も）」を記載の上お申込みください。  
②ホームページよりダウンロードした予稿テンプレートをご利用いただき、完成原稿をPDFにてご送付ください。  
発表者の方は予稿原稿の他に、ポスターの作成および論文原稿の執筆をお願いいたします。

- 発表申込、予稿原稿締切：  
**11月6日（金）**
- 論文（Proceedings）原稿締切：  
**12月11日（金）**

- ・シンポジウム申込先及び  
予稿集原稿、論文原稿送り先  
E-MAIL : [ion-sympo@ml.hosei.ac.jp](mailto:ion-sympo@ml.hosei.ac.jp)

「氏名」「所属」を記載の上、  
ion-sympo@ml.hosei.ac.jp 宛に申込をお願いいたします。

・参加費 無料

- 予稿集、  
Proceedings 各無料  
(後日郵送予定)